

日本電子(株)製走査型電子顕微鏡 JSM-6500F

製造元	日本電子(株) 購入年度：2004 年度
仕様	JSM-6500F, 加速電圧：0.5～30 kV, 二次電子像分解能：1.5 nm (加速電圧 15 kV), 5.0 nm (加速電圧 1 kV), 倍率：10～50 万倍, 最大試料サイズ：φ30 mm
保有部署	電子工学専攻半導体物性工学研究室
設置場所	桂・A1 棟・B1 階 009 室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210311-denshi/
注意事項	利用講習を受講のうえ、利用者自身で測定
連絡先	電子工学専攻川上研究室 075-383-2309 sem-yui@optomater.kuee.kyoto-u.ac.jp (利用申請前に、利用の概略(形式任意)をこちら宛にお知らせください。)
キーワード	表面構造観察, マイクロ・ナノ材料, 半導体, 無機材料
機器コード	0000107003
自由記入欄	本装置は、高輝度な熱電界放出型電子銃を備え、セミインレンズ型の対物レンズにより、高分解能での表面構造の観察に適しています。

